

# 軌道安定化 & SRモータ

東京大学物性研究所  
中村 典雄

# 軌道変動源と軌道安定化

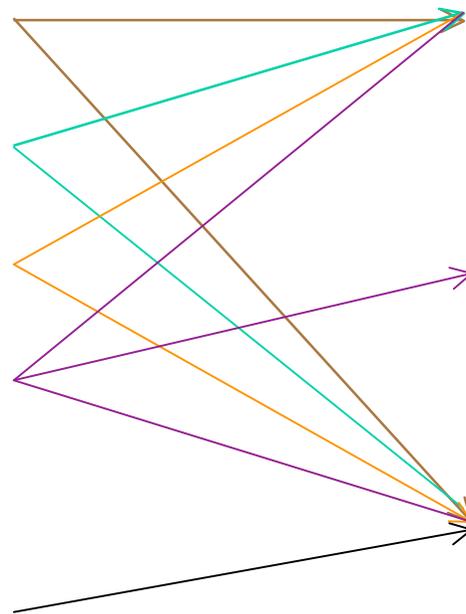
建物の変形  
地盤振動

冷却水・空調

電氣的ノイズ

挿入光源(ID)  
ギャップ変更  
偏光スイッチ

その他  
原因不明



変動源の除去

建物・ユーティリティ設計  
加速器機器設計・ID端部補正

フィードフォワード制御

ID積分磁場の補正  
チューン補正

軌道フィードバック

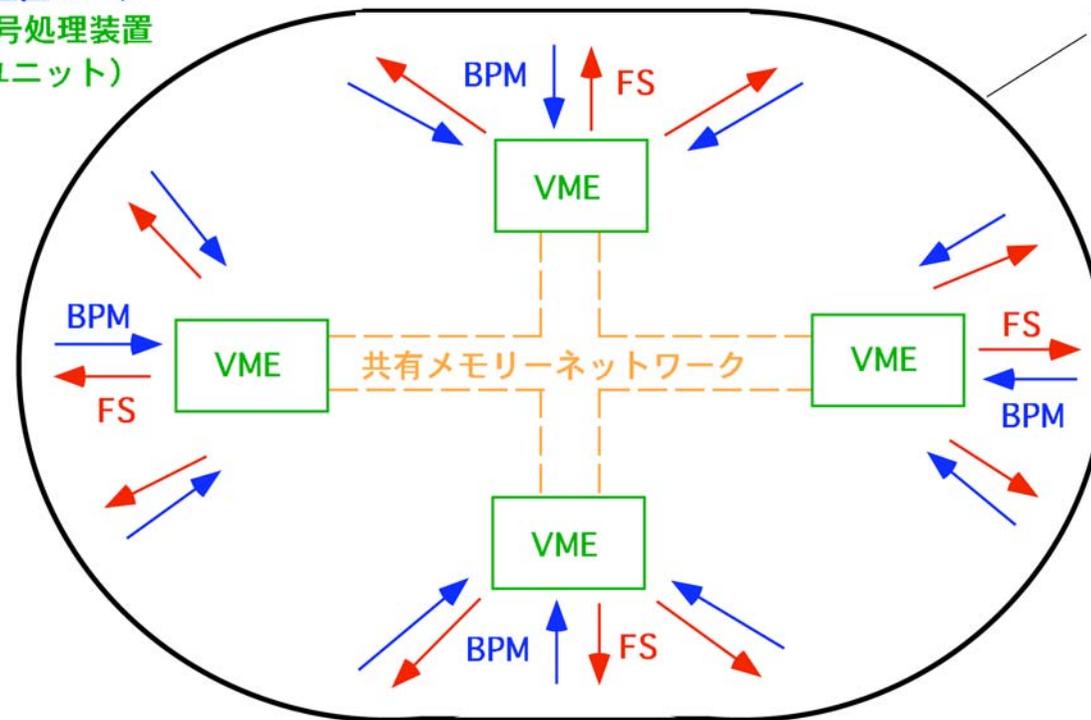
変動周波数 0 ~ 100 Hz、低周波数での変動大

# 軌道フィードバックシステム

FS:フィードバック用補正電磁石  
BPM:ビーム位置モニタ  
VME:高速信号処理装置  
(制御ユニット)

光源リング

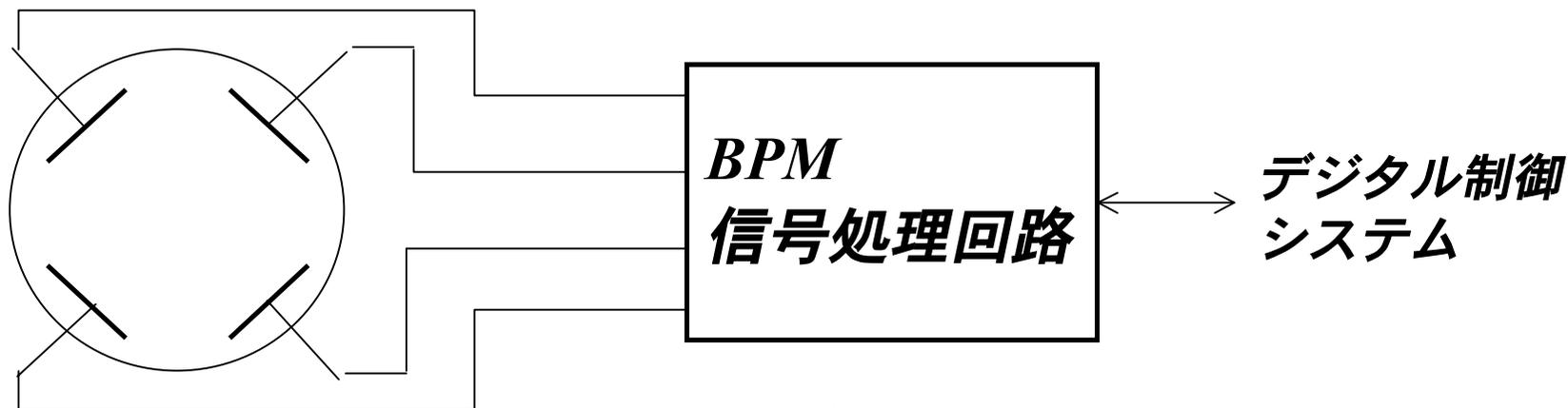
BPM 140台  
FS 70台  
VME 14台(+1台)



目標：サブミクロンの安定化

- (1) 高速高精度ビーム位置測定  $< 1 \mu\text{m}$
- (2) 軌道変動減衰度  $-20\text{dBz}$ 以下 @ 10Hz (帯域 100Hz以上)
- (3) 挿入光源での安定度重視

# ビーム位置モニタ (BPM)



## BPM電極部

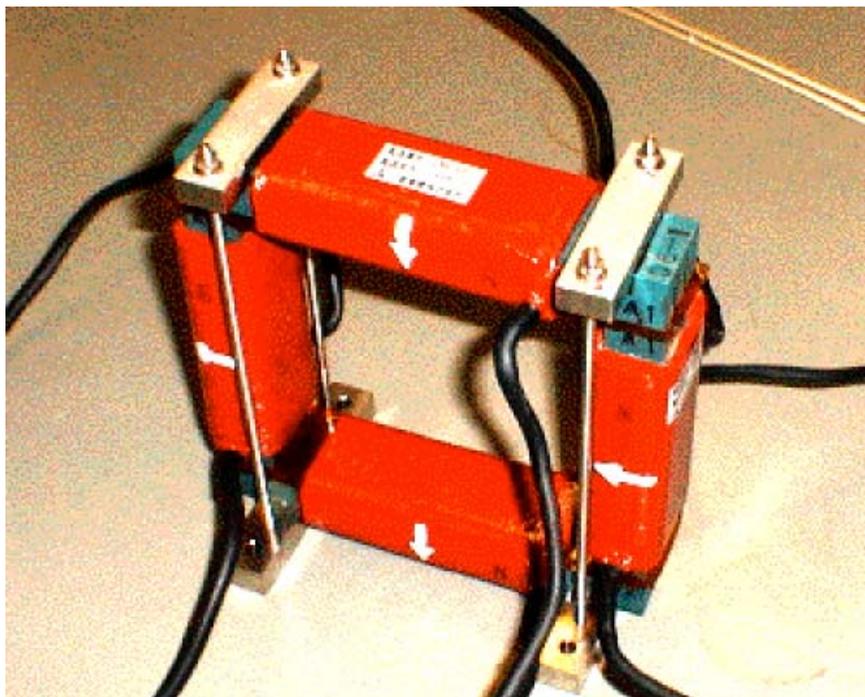
### BPM電極部の設計

- ・ブロック構造
- ・架台による固定
- ・アブソーバによる放射光からの保護
- ・ベローズによるストレスの吸収
  - (・ トップアップ入射による温度の安定化)
  - (・ 空調の精密制御による架台伸縮の抑止)

### BPM信号処理回路の設計・選択

- ・スーパーヘテロダイン&電極切換方式
  - 1 BPMに1回路
  - 1 ターン測定は不可
- ・DBPM(Digital BPM)方式
  - 1 電極に1回路
  - 1 ターン測定可能

# ステアリング電磁石システム

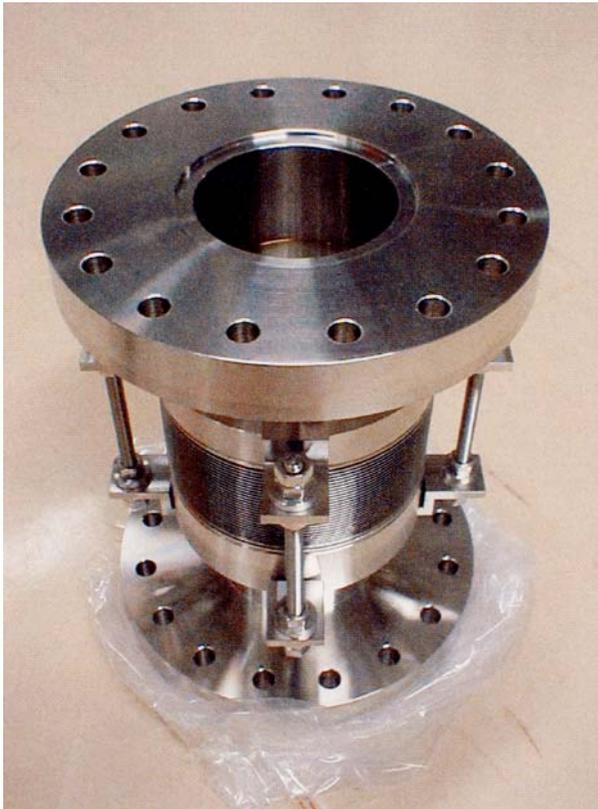


ステアリング電磁石（積層硅素鋼板）

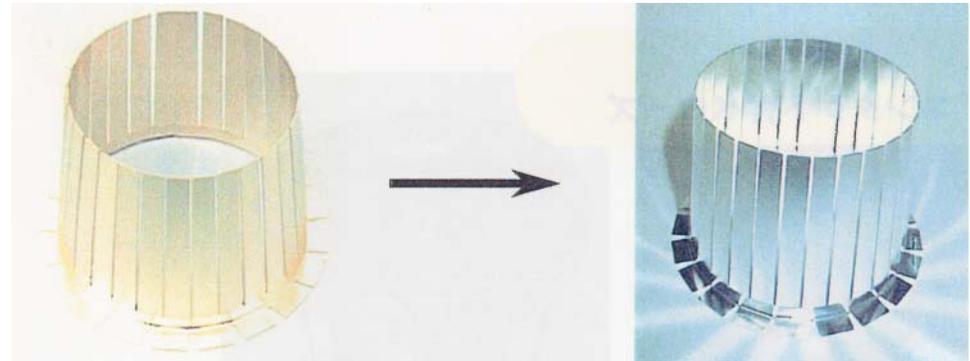


ステアリング電磁石電源  
スイッチング方式  
(リップルノイズ)  
↓  
リニアアンプ方式

# R F シールド付きベローズ



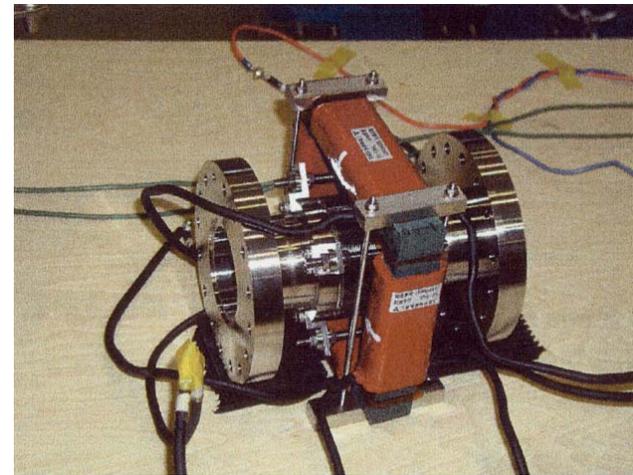
R F シールド付きベローズ



銀メッキ前 (ベリリウム銅製)

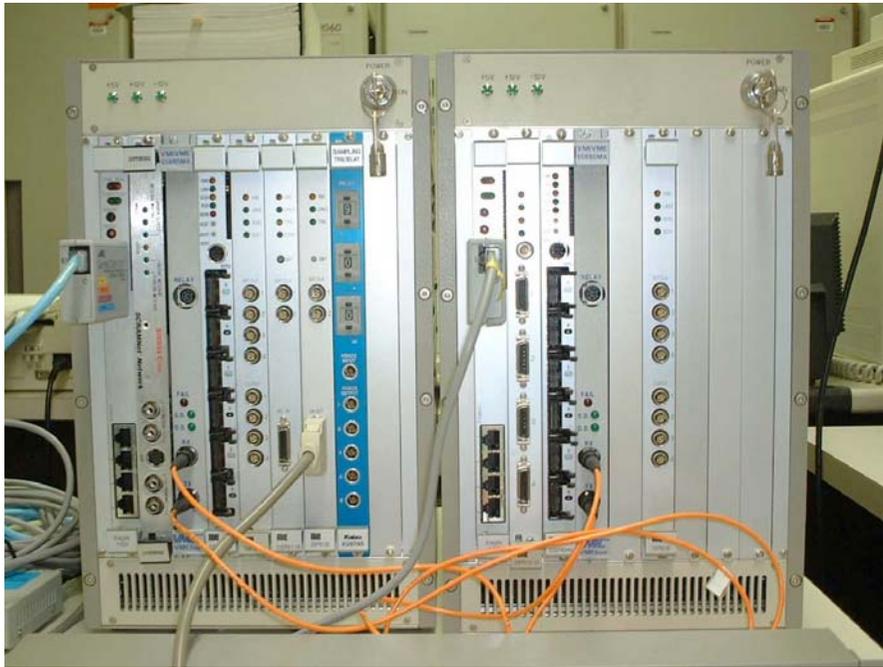
銀メッキ後

R F シールド

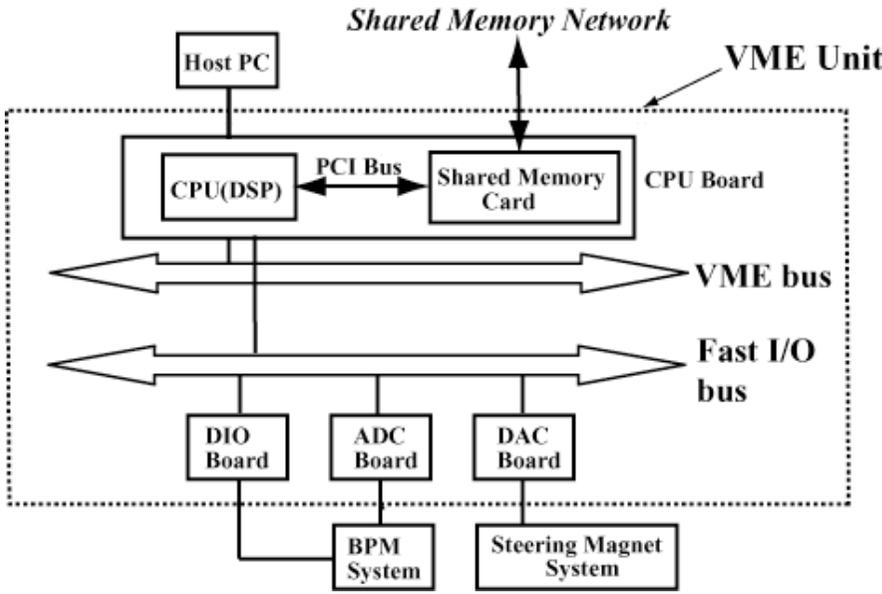


ステアリング+ベローズ

# フィードバック制御システム（1）



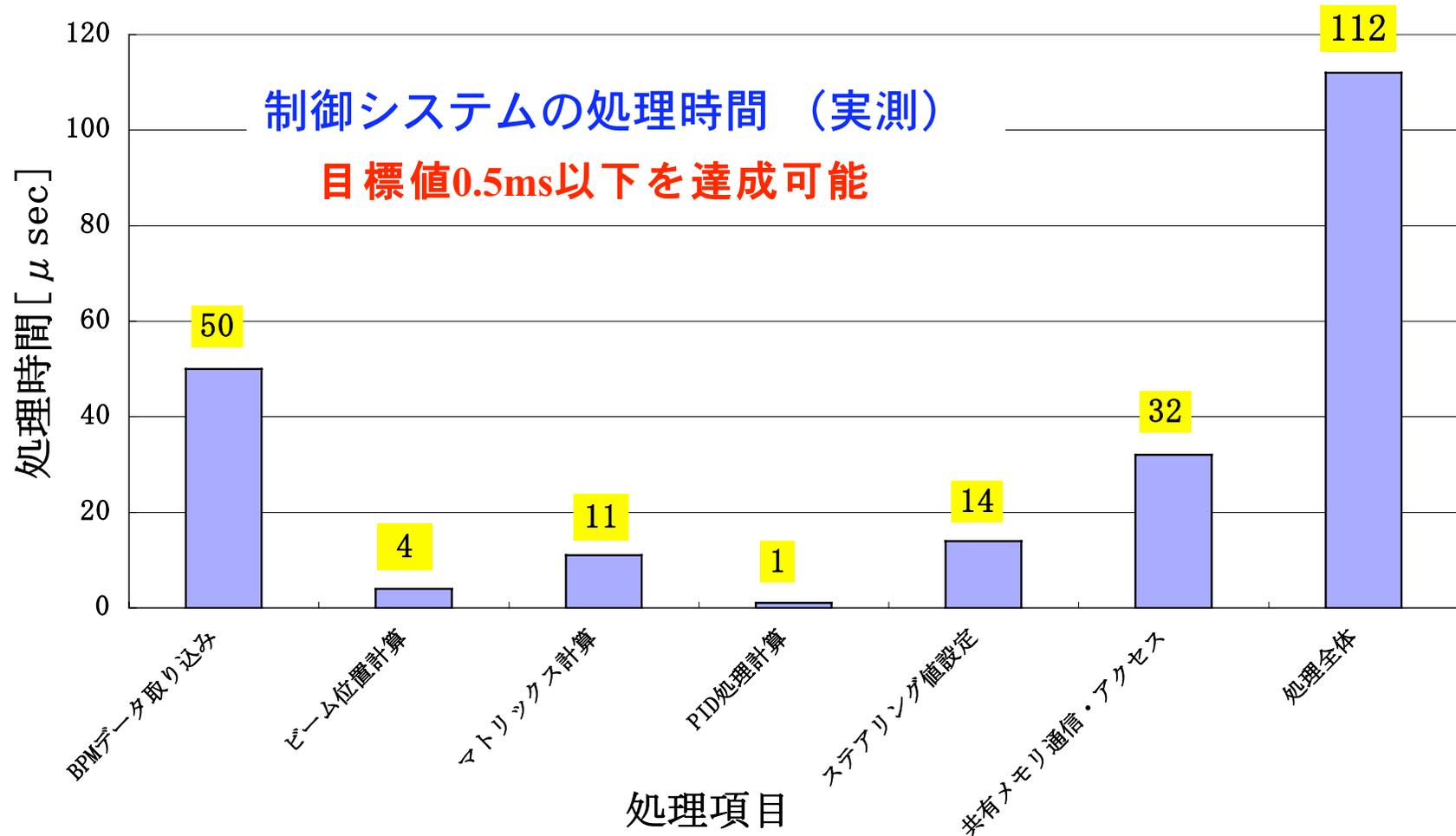
制御ユニットx2（初期モデル）



制御ユニットブロック図（現状）

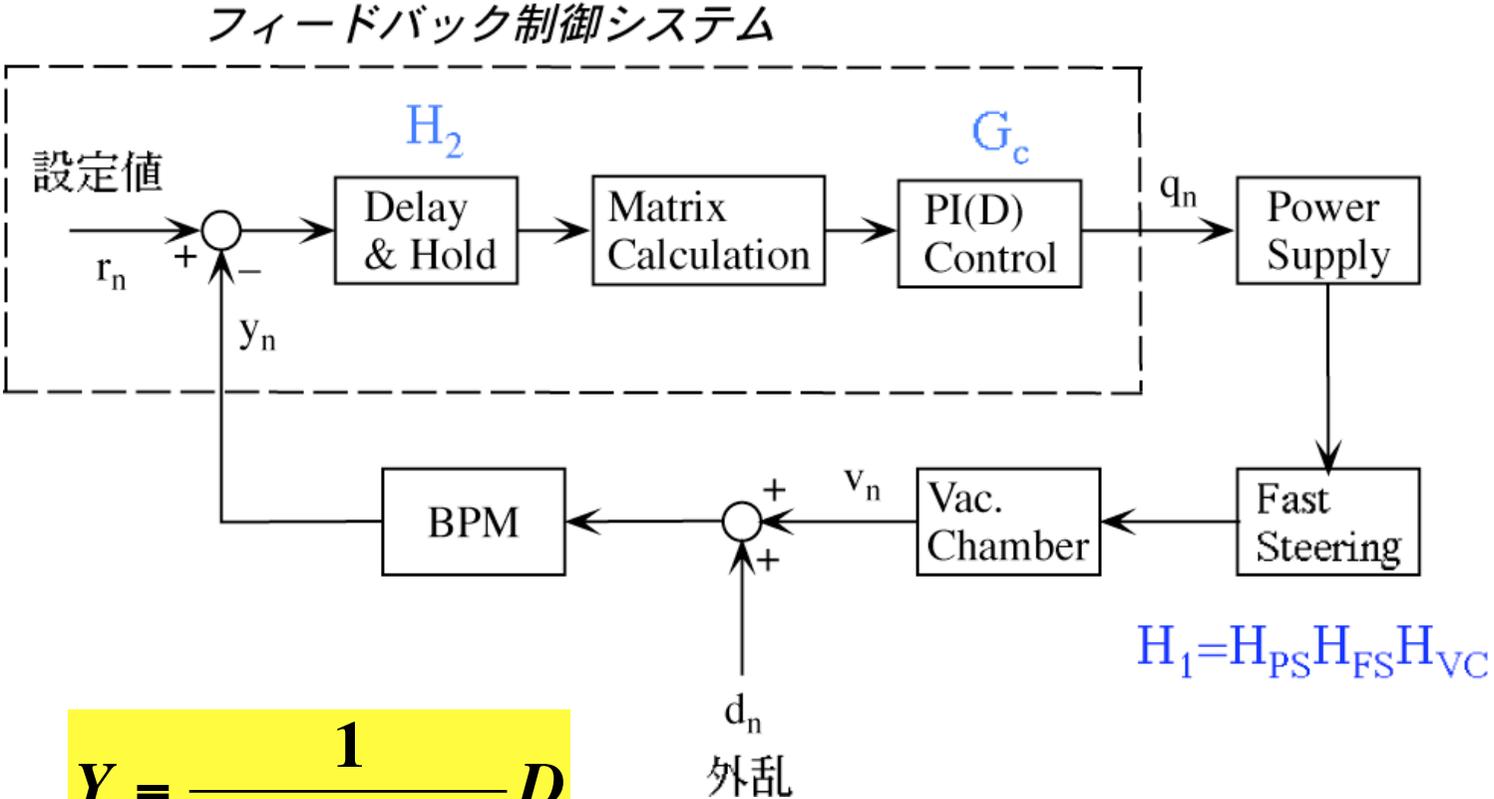
フィードバック周期（目標）： $T_s=0.5ms$

# フィードバック制御システム（２）



- 条件 1) VME1 4 台でビーム位置モニタ (BPM) 140 台、ステアリング電磁石電源 70x2=140 台を処理する。
- 条件 2) 共有メモリ通信・アクセス時間には、VME1 台当り 20 個のデータリード (x、y 各 10 個) と 280 個 (全 BPM の x、y) のデータライトを想定している。
- 条件 3) 減衰器制御、スイッチ切換待ち時間、その他オーバーヘッドなどは含まれていない。

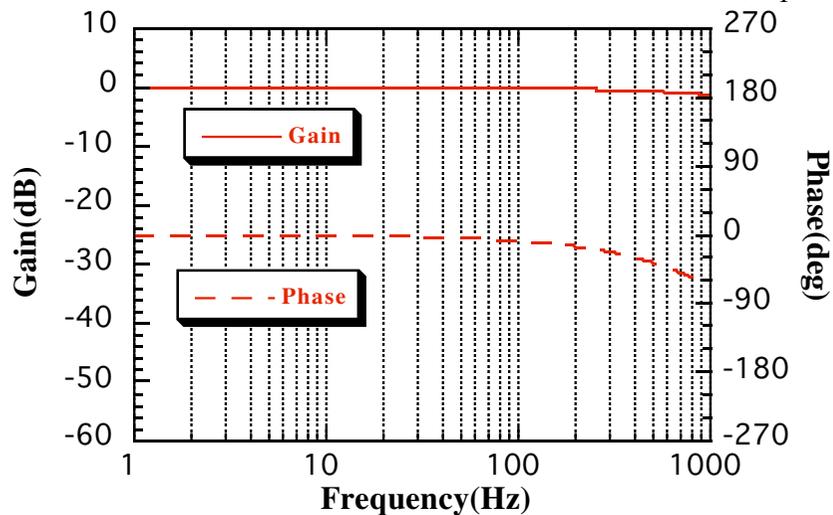
# フィードバック制御システム



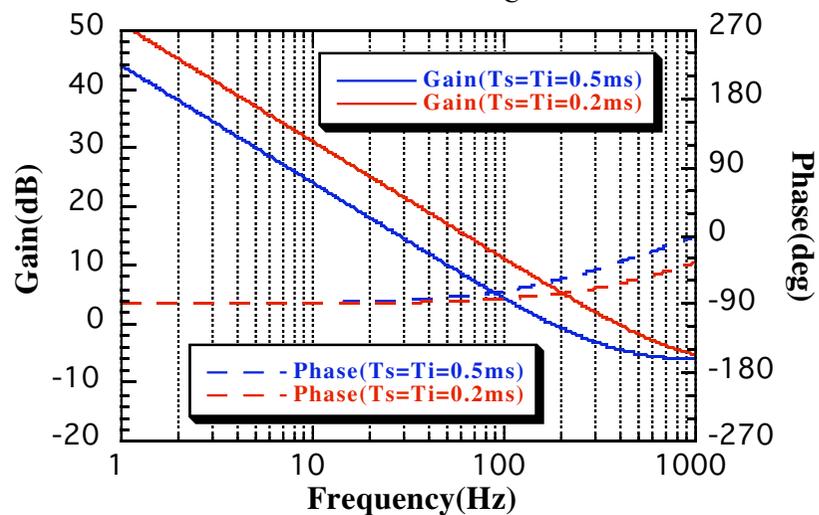
$$Y = \frac{1}{1 + H_1 H_2 G_c} D$$

# 周波数応答

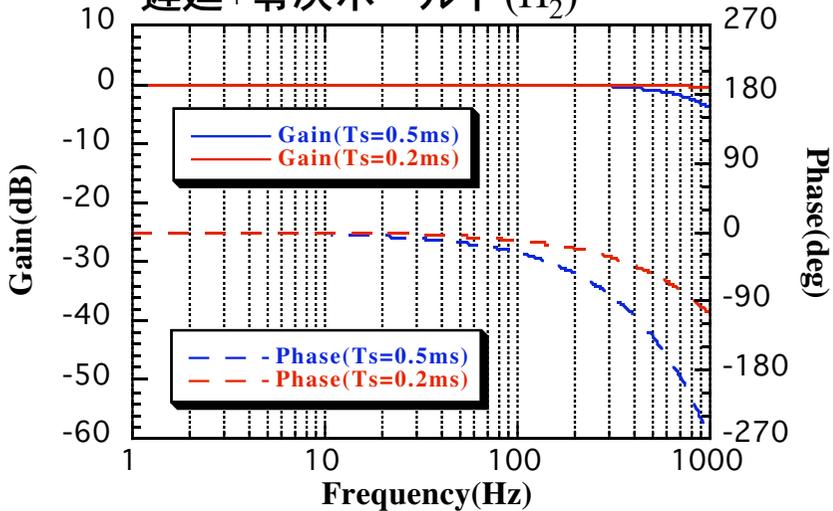
ステアリング・電源+SUSベローズ( $H_1$ )



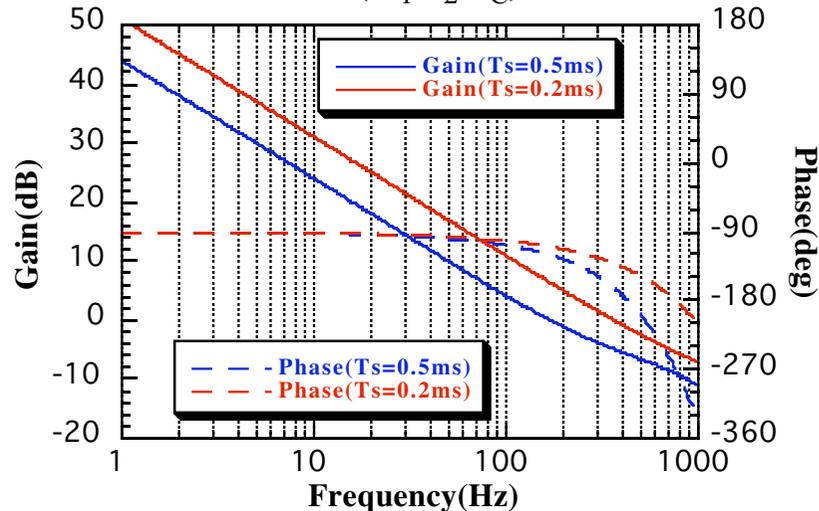
ゲイン+PI補償 ( $G_C$ )



遅延+零次ホールド( $H_2$ )

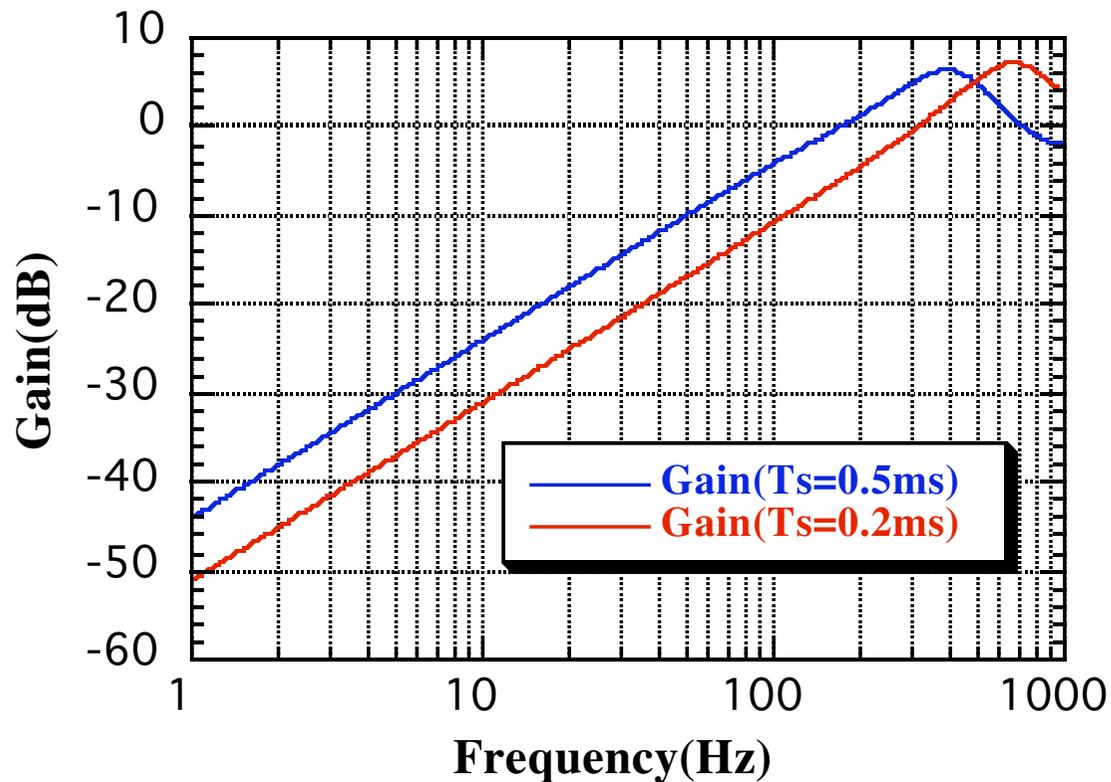


開ループ ( $H_1H_2G_C$ )



# 軌道変動減衰度

閉ループゲイン ( $=1/|1+H_1H_2G_C|$ )



帯域100Hz、 $< -20dB @ 10Hz$ を達成可能

# 新しい軌道補正方法（１）

## 従来の軌道補正方法

### グローバル補正

リング全周に渡る補正  
少ない電磁石で効率的に補正  
局所的な補正は困難  
(例：固有ベクトル法)

### ローカル補正

光源点など特定場所での  
局所的な補正が可能  
多くの電磁石が必要  
(例：ローカルバンプ法)

フィードバック間の干渉

統一化

## 新しい軌道補正方法（条件付き固有ベクトル法）

両方（グローバル／ローカル補正）の機能を兼備  
単一のフィードバックループ（干渉がない）  
挿入光源付近での軌道をより重点的に補正可能  
その他に様々な束縛条件を付加可能（例：光位置モニタ）

# 新しい軌道補正方法（2）

Residual vector of COD:

$$\vec{\Delta} \equiv R\vec{\theta} + \vec{y} \quad (1)$$

$y$  : beam position before correction ( $M$ )

$\theta$  : kick angle of steering magnet ( $N$ )

$R$  : Response matrix ( $M \times N$ )

Constraint conditions:

$$\vec{C}_i^T \cdot \vec{\theta} + z_i = 0 \quad (i = 1, \dots, N_C) \quad (2)$$

Minimize the norm of  $\Delta$  under the constraint conditions by introducing the following function of  $S$  (Lagrange's method of indeterminate multipliers).

$$S = \frac{1}{2}(R\vec{\theta} + \vec{y})^2 + \sum_i^{N_C} \mu_i (\vec{C}_i^T \vec{\theta} + z_i) \quad (3)$$

Set derivatives of the function  $S$  with respect to  $\theta$  and  $\mu$  to zero.

$$R^T R \vec{\theta} + R^T \vec{y} + C \vec{\mu} = 0 \quad (4)$$

$$C^T \vec{\theta} + \vec{z} = 0 \quad (5)$$

Solution of the above equations:

$$\vec{\theta} = B\vec{y} - D\vec{z} \quad (6)$$

where

$$B = (-A^{-1} + A^{-1}CP^{-1}C^T A^{-1})R^T \quad (7)$$

$$D = A^{-1}CP^{-1} \quad (8)$$

$$A = R^T R \quad P = C^T A^{-1} C \quad (9)$$

Definition of the matrix  $A^{-1}$ :

$$A^{-1} = \sum_{i=1}^{N_V} \frac{\vec{v}_i \vec{v}_i^T}{\lambda_i} \quad (N_V \leq N), \quad (10)$$

$v_i$  :  $i$ -th eigenvector of the matrix  $A$

$\lambda_i$  :  $i$ -th eigenvalue of the matrix  $A$

For zero and small eigenvalues, their reciprocals in the matrix  $A^{-1}$  is replaced with zeros to avoid very large kick angles of steering magnets. The condition of  $N_V \geq N_C$  is required for the existence of the inverse matrix  $P^{-1}$ .

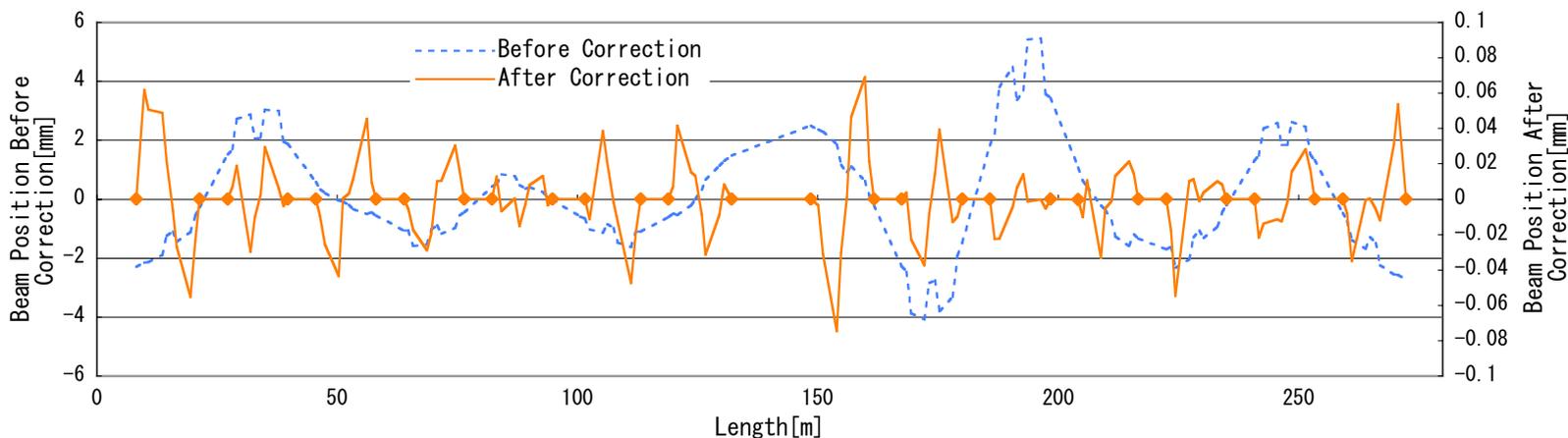
If  $\vec{y}$  is taken as the beam positions measured at arbitrarily selected BPMs and  $C$  as the corresponding part of the response matrix  $R$ , Eq. (6) can be rewritten in a simplified form,

$$\vec{\theta} = B^* \vec{y}$$

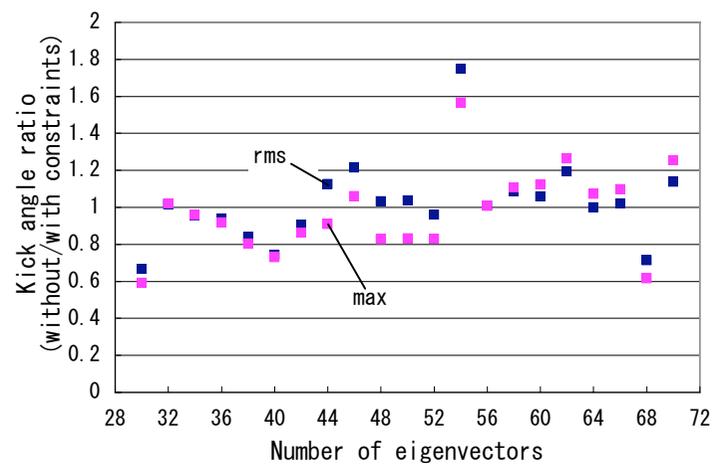
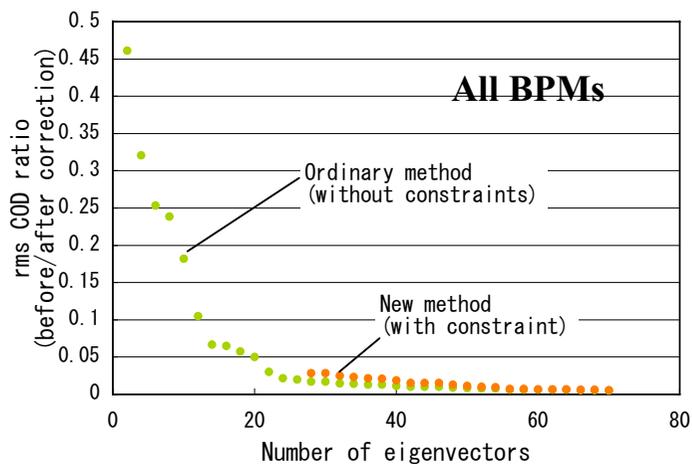
# 新しい軌道補正方法（3）

SuperSOR

計算機シミュレーション 挿入光源両脇のBPM 28台に束縛条件（BPM140台, FS 70台）



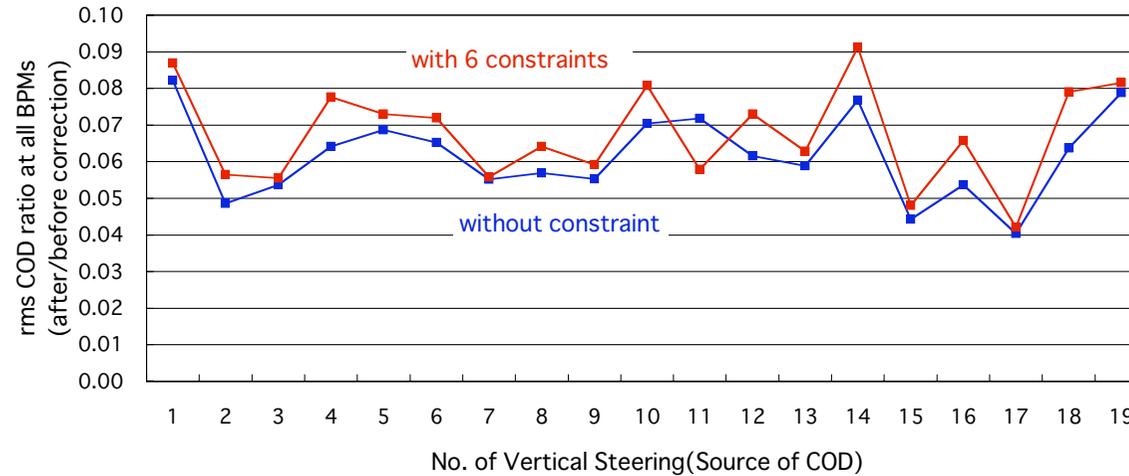
新しい方法による補正前後の軌道（固有値 50, 束縛条件 28）



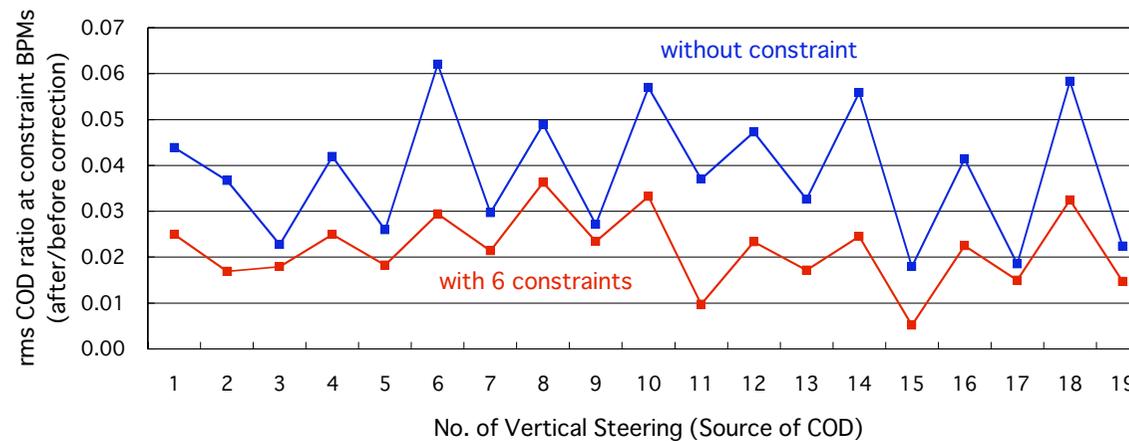
新しい方法と従来の固有値法との比較

# 新しい軌道補正方法（４）

## PF-ARでの試験（実測）



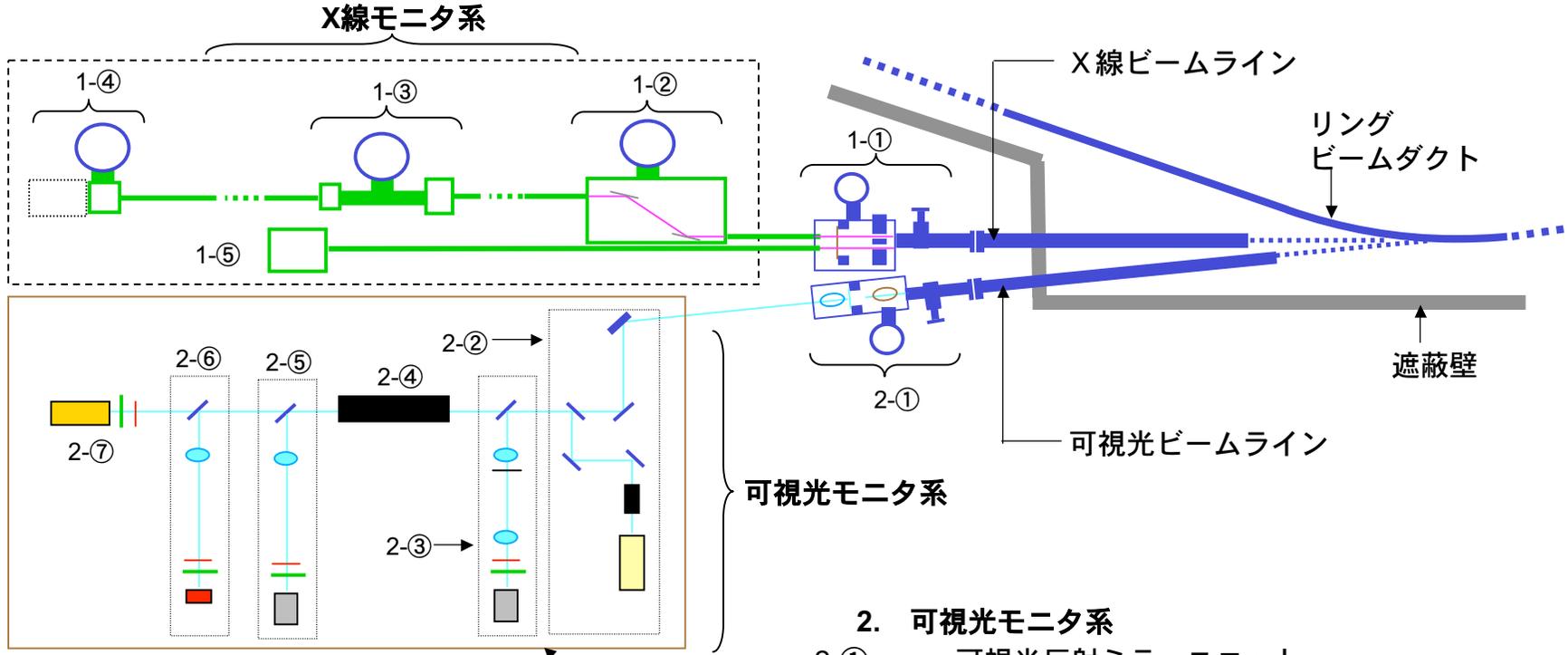
## 新しい方法と従来の固有値法との比較（全BPMでのCOD）



光源点でより精密な補正が可能

## 新しい方法と従来の固有値法との比較（束縛された6BPMでのCOD）

# 放射光モニタ

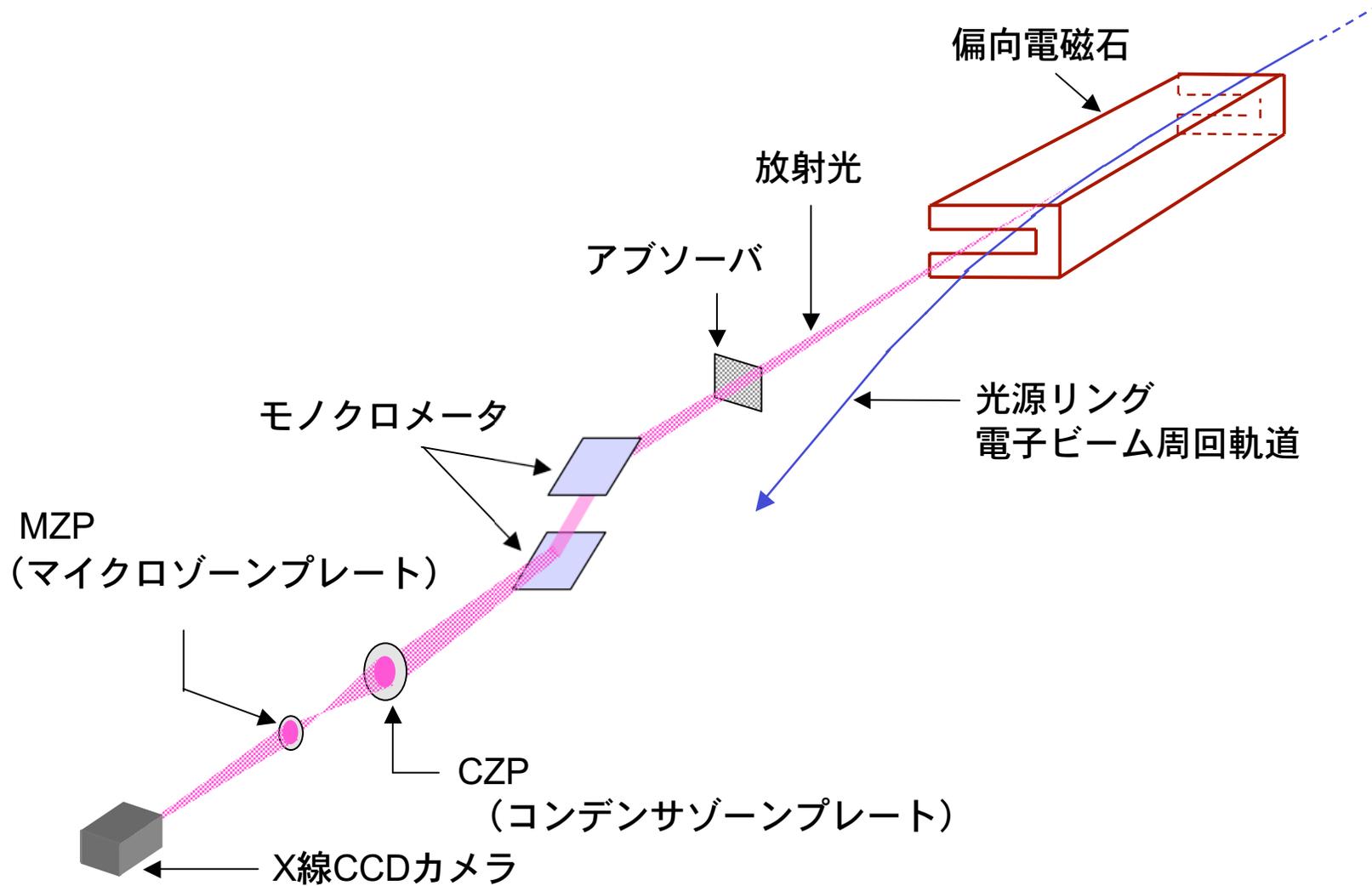


- 1. X線モニタ系**
- 1-① : クロッチ+X線窓
  - 1-② : モノクロメータユニット
  - 1-③ : FZPユニット
  - 1-④ : X線CCDカメラ収納ユニット
  - 1-⑤ : 放射光位置モニタ

- 2. 可視光モニタ系**
- 2-① : 可視光反射ミラーユニット
  - 2-② : レーザアライメントユニット
  - 2-③ : 干渉光学系ユニット
  - 2-④ : テレスコープ
  - 2-⑤ : プロファイルモニタ光学系ユニット
  - 2-⑥ : チューンモニタ用光学系ユニット
  - 2-⑦ : ストリークカメラ
  - 2-⑧ : 光学ベンチ+遮光BOX

**放射光モニタ配置案**

# 電子ビームプロファイルモニタ



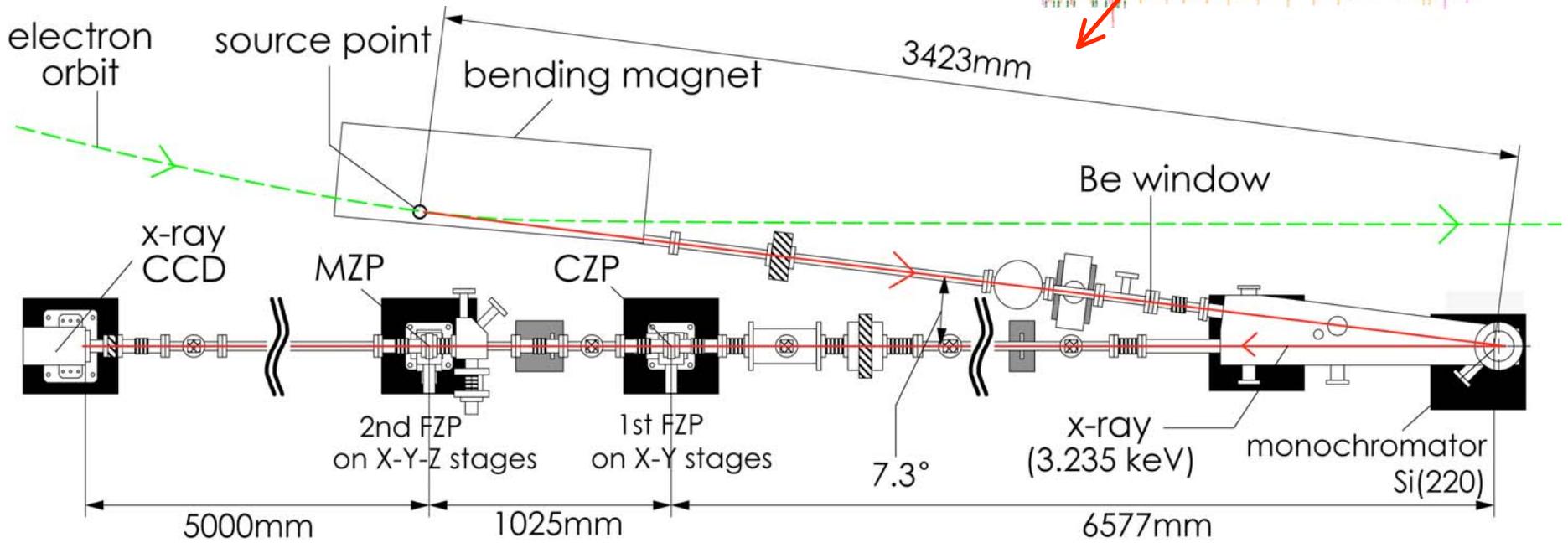
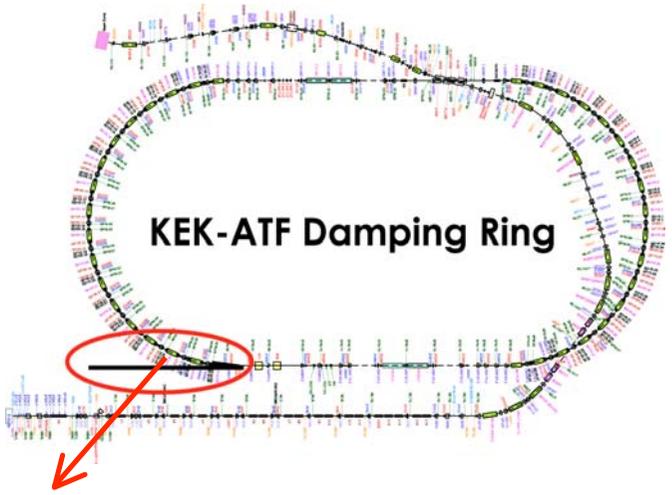
# R&D (1)

## 測定システム

拡大率  $M = M_{CZP} \times M_{MZP}$

空間分解能  $\delta_0 = \delta_{CZP} / M_{CZP}$

$M=20$  ( $M_{CZP}=1/10$ ,  $M_{MZP}=200$ ),  $\delta_0=1.7 \mu\text{m}$



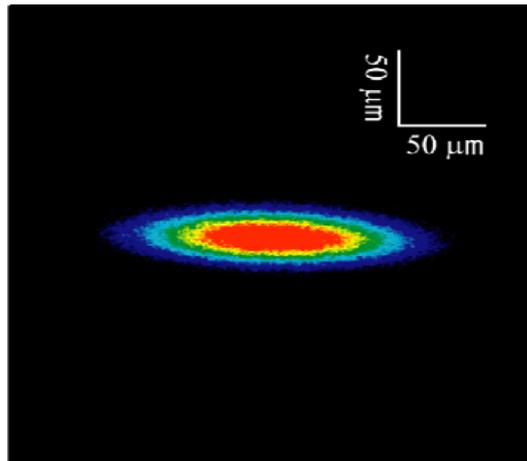
# R&D (2)

## 測定結果

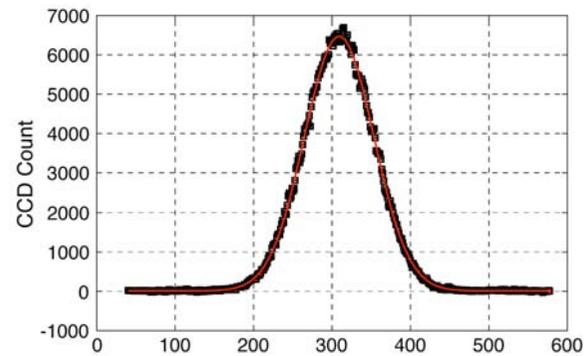
2003.03.11, I=1.96mA(SB),  $T_{\text{exp}}=400\text{ms}$

$$\sigma_x = 44.2 \pm 1.2 [\mu\text{m}]$$

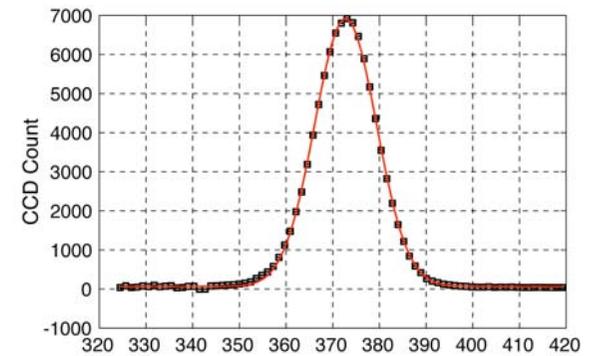
$$\sigma_y = 6.67 \pm 0.19 [\mu\text{m}]$$



電子ビーム像



Horizontal profile



Vertical profile

電子ビーム形状&サイズ

# まとめ

- 軌道フィードバックシステムは、軌道変動による輝度の実効的低下を抑えるために、光源点のサブミクロンの位置の安定化を目標として開発している。
- 1  $\mu\text{m}$ 以下の高精度で高速軌道測定を行えるために、ビーム位置モニタ（信号処理回路を含む）の設計・開発が進行中である。
- 高速ステアリング電磁石は積層ケイ素鋼板コアを用い、電源についてはリニアアンプ型を採用・開発する。また、電磁石をアルミ製ダクトの代わりに、ベローズ（SUS製、BeCu製RFシールド付）に設置することで、渦電流による周波数応答の劣化を防ぐ。
- フィードバック制御システムは、最新のCPU(DSP)&共有メモリカードと高速バスを使うことで目標であるサンプリング周期0.5ms以下を達成できる。結果として、ビーム変動の減衰度として $< -20\text{dB} @ 10\text{Hz}$ （帯域100Hz以上に対応）が実現できる。
- 新しい軌道補正方法（条件付き固有ベクトル法）によって、挿入光源での位置の安定化をより高める。現在、計算機シミュレーションの他に、実際のビームを用いた評価を行いつつある。
- 放射光モニタについては、ビームサイズ測定用に2つのゾーンプレートによるX線結像光学系を用いた高分解能ビームプロファイルモニタの開発を行っている。